

高感度・高分解能表面電位測定手法

発明者：国立大学法人京都大学

AFMを用いた表面電位分布の新しい測定技術を用いて
原子・分子の「識別」を実現

発明分野

原子間力顕微鏡 (AFM)

背景

従来の表面電位測定技術 (KFM)

① FM-KFM

カンチレバーを1次共振モード、プローブ-試料間にPLL応答周波数以下の変調電場を印加

② 2次共振AM-KFM

カンチレバーを1次共振モード、プローブ-試料間に2次共振周波数の変調電場を印加

発明の概要

カンチレバーの **関西TLO**

関西TLO

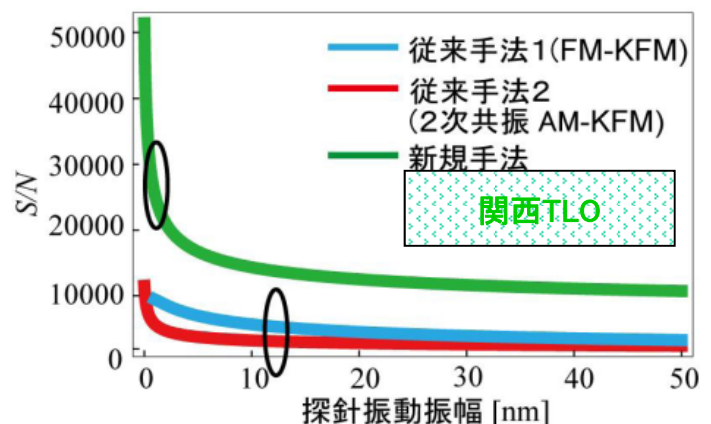
により **高感度化・高速化** を実現

発明の効果

本発明の高感度化手法の開発により、従来の分解能観察を超え、材料表面の **原子・分子の識別** が可能となる



- ・高感度化
- ・プローブの制御容易
- ・スキャン速度向上



関西TLO

Technology Licensing Organization

連絡先

〒600-8216 京都市下京区西洞院通塩小路下る
東塩小路町939番地 キャンパスプラザ京都6F
TEL (075)353-5890 / FAX (075)353-5891
E-mail : tlo@kansai-tlo.co.jp